

证券代码:300567 证券简称:精测电子 公告编号:2026-105

武汉精测电子集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当同时阅读指定媒体刊登并阅读半年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
 适用√不适用
 董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用√不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 适用√不适用
 二、公司基本情况
 1. 公司简介

股票简称	精测电子	股票代码	300567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人及联系方式	无	董事会秘书	证券事务代表
电话	027-87071129	027-87071179	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭路2号		
电子邮箱	huanghua@wuhangjcs.com	chenjgm@wuhangjcs.com	

2. 主要会计数据和财务指标
 公司是否曾追溯调整或重述以前年度会计数据
 是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,811,076,512.09	1,381,004,102.09	31.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,004,344.21	27,066,381.74	171.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-722,707,749.08	-469,636,503.32	-52.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.27	0.10	170.00%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.14	157.14%
加权平均净资产收益率	1.72%	0.76%	0.96%
总资产(元)	19,229,328,163.82	11,602,062,204.72	13.52%
归属于上市公司股东净资产(元)	5,817,912,241.71	4,241,691,456.64	34.00%

3. 公司股东数量及持股情况
 单位:股

报告期末普通股股东总数	32,027	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况	数量
彭程	境内自然人	20.91%	56,500,000	52,594,000	0
陈凯	境内自然人	8.05%	22,529,813	0	0
武汉汉鼎世纪信息股份有限公司	其他	5.02%	14,044,100	0	0
中国银行股份有限公司	其他	3.44%	9,610,189	0	0
中国建设银行股份有限公司	其他	3.00%	8,383,965	0	0
中国工商银行股份有限公司	其他	2.47%	6,501,108	0	0
武汉汉鼎世纪信息股份有限公司	其他	1.73%	4,850,068	0	0
武汉汉鼎世纪信息股份有限公司	其他	1.68%	4,687,987	0	0
武汉汉鼎世纪信息股份有限公司	其他	1.42%	3,960,550	0	0
武汉汉鼎世纪信息股份有限公司	其他	1.06%	2,980,880	0	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
 适用√不适用
 前10名股东及前10名无限售流通股股东转融通出借/买入期间导致上市公司发生的变化
 适用√不适用
 公司是否持有表决权差异安排
 是√否
 4. 控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 适用√不适用
 实际控制人报告期内变更
 适用√不适用
 公司报告期内实际控制人发生变更
 适用√不适用
 5. 公司报告期内实际控制人发生变更
 适用√不适用
 6. 在半年度报告批准报出日存续的限售情况
 适用√不适用
 (1) 限售基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	精测转债	123176	2026年03月02日	2036年03月01日	127,529,131	15.0001

注:001 第一年为0.20%,第二年为0.40%,第三年为0.60%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2%。
 (2) 截至报告期末的财务指标
 单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产总额	49,977	55,593
负债总额	1,62	1,66
净资产	6,986	5,927

三、重要事项
 (一) 主营业务概况
 报告期内,公司主营业务聚焦于半导体、显示及新能源三大核心领域检测系统的设计、生产与销售,凭借成熟可靠的技术解决方案与专业技术服务能力,深度服务于下游半导体晶圆制造厂商、显示面板制造厂商及新能源电池生产厂商,为客户提供全方位的质量检测设备与技术支持。报告期内,公司的主要业务、经营模式未发生变化。
 (二) 主要产品及用途
 1. 半导体检测领域
 公司目前在半导体领域的主要产品分为前道量检测设备、后道电源检测设备、先进封装量检测设备和核心器件等,包括膜厚测量系统、光学关键尺寸测量系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量系统、明场光学缺陷检测设备和自动检测系统(ATE)等,用于晶圆加工、制造、封装环节的物理参数测量与性能性检测,是先进制程制程管控核心装备。
 (1) 前道量检测设备

产品名称	图示	产品用途
EPFILM FDS/DS/IM Series 膜厚测量系统		膜厚测量系列专为先进、成熟半导体制造工艺开发,可精确测量5纳米以下逻辑器件及存储器件中的各类薄膜厚度参数,全面满足先进制程对膜厚精度控制的要求。该系统采用激光干涉光(LDI)结合先进的光学检测技术,实现纳米级膜厚测量精度与光学检测的高精度测量,为工艺优化提供精准数据支撑,显著提升制程稳定性和量产效率。此外,该系统产品还特别支持对高介电常数(HIGH-K)的精确测量,进一步满足先进制程的测量需求。
EPROFILE Series 轮廓测量系统		用于三维形貌测量系列专为先进半导体制造工艺开发,可精准表面形貌、粗糙度、台阶高度等关键参数,以及非接触式NANO型器件、DRAM存储器件等复杂三维结构形貌的精确测量。该系列产品深度融合光学干涉技术与自主研发的智能算法,能有效识别并补偿检测中的多种影响因素,可实现高精度、高速度、高稳定性的测量,为制程优化提供关键工艺参数。此外,其三维形貌测量精度达纳米级,对工艺过程敏感度的检测灵敏度提升3倍。
MetaPAM Series 高精度膜厚测量系统		MetaPAM Series系统是一款全面的在线膜厚测量工具,适用于干法镀膜、物理、化学沉积和物理气相沉积等多种工艺。该系统采用先进的干涉测量技术,能够实现从0.1nm到100nm的宽范围膜厚测量,精度可达0.1nm,并可同时测量厚度、粗糙度、折射率等多种参数。从晶圆加工到封装过程中的信息转换和实时监控。
SCALE Series 轮廓测量系统		基于PTIR技术的高精度后工艺工程方案,SCALE EPI Series集成探针与红外光源(PTIR)与先进算法,实现后工艺厚度及元素浓度分布的快速检测。该系统采用非接触式测量,可实现对Si、Al、Cu等元素浓度进行测量,支持从供应链质量控制(测试站)到量产工艺实时监控(产品品质)的全流程数据应用,为优化制程、提升产品质量等关键环节提供精准数据支撑。
eMetric Series 电子束关键尺寸测量系统		产品具有包括探针电子显微镜在内的核心器件的全面自主知识产权,该设备具有非接触式高精度测量能力,可实现对微小尺寸(如0.1μm)的关键尺寸进行高精度测量。同时,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
IG 1D/3D/2D系列 轮廓测量系统		用于测量具有无规则表面形貌及应力的设备,它通过高精度的光学系统对样品表面进行非接触式测量,可提供具有微米级精度的实时数据,用于实时监控和优化生产过程。
DM Series 离子探针		离子注入、退火工艺是半导体制造中一系列对导电性进行注入和退火的关键工艺,离子探针是离子注入和退火工艺中不可或缺的关键设备。DM Series系统可实时监控离子注入和退火过程中离子束的分布和能量,确保离子注入的精确性和均匀性,从而提高器件的性能和良率。
eView Series 电子束(e-beam)晶圆缺陷检测系统		eView Series电子束(e-beam)晶圆缺陷检测系统由前道系统可集成缺陷检测系统,从而实现对晶圆缺陷的实时监控。该系统采用先进的电子束检测技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
View/AeroScan Series 3D-SEM系列 3D-SEM系列		AeroScan Series系统是集成SEM和FIB于一体的,两者的结合,在保持高分辨率(30nm)的同时,可实现对样品的快速扫描和成像。该系统采用先进的扫描电镜技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
View/AeroScan Series 3D-SEM系列 3D-SEM系列		AeroScan Series系统是集成SEM和FIB于一体的,两者的结合,在保持高分辨率(30nm)的同时,可实现对样品的快速扫描和成像。该系统采用先进的扫描电镜技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。

(2) 半导体后道检测领域

产品名称	图示	产品用途
J-Metron 6000 Series 电测机		J-Metron 6000 Series 是一款先进的电测系统,用于测试半导体器件的电学性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 是一款先进的存储器测试系统,用于测试存储器的性能。该系统采用先进的测试技术,可实现对微小缺陷(如0.1μm)的精确检测,检测速度可达6000缺陷/秒。该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。此外,该系统还具备高速度、高精度测量能力,可满足先进制程对关键尺寸实时监控的需求。
J-H502/H500/H500A/H500B HI Test System 存储器 HI 测试设备		J-H502/H500/H500A/H500B